科学研究費助成事業

平成 29 年 5月31日現在

研究成果報告

니까지다

研究成果の概要(和文):本研究では、プラズマプロセスを用いた新規Geナノ粒子膜堆積法を開発し、さらにGe ナノ粒子膜を負極材に用いた高容量Liイオン電池を実証した。具体的には、スパッタ法を用いてGeナノ粒子を気 相中で生成し、ガス流により基板へと輸送した。放電アルゴンガスに水素ガスを20%程度添加することにより、 ナノ粒子構造はアモルファス構造から結晶構造へと変化し、膜全体の80%以上が結晶成分の結晶Geナノ粒子膜の 堆積に成功した。この結晶Geナノ粒子膜を負極材としたLiイオン電池を試作し、初期容量として理論値に近い約 1600 mAh/gを、また、充放電50サイクル後の容量として約600 mAh/gを得た。

研究成果の概要(英文): We have developed a new plasma process for the fabrication of the Ge nanoparticle films, and applied the films to Li ion batteries. In the experiments, we have deposited crystalline Ge nanoparticle films using a radio frequency magnetron sputtering method in argon and hydrogen gas mixture under a high pressure condition. In the process, Ge nanoparticles were generated in the reactive plasma, and were transported to the downstream substrate by neutral gas flow. The Ge nanoparticles transited from amorphous to crystalline structure by adding H2 gas in the Ar discharge gas. We evaluated performance of Li ion batteries with crystalline Ge nanoparticle film as anode material. The first cycle of charge/discharge property showed that the capacity was around 1600 mAh/g. The discharge capacity remained at about 600 mAh/g after 50th cycle.

研究分野: プラズマ理工学

キーワード: ゲルマニウム プラズマプロセス ナノ粒子 Liイオン電池

1. 研究開始当初の背景

リチウム(Li)イオン電池の電気自動車へ の搭載には、現行の2倍以上のエネルギー密 度を有する革新的 Li イオン電池の開発が必 要不可欠であり、なかでも負極材料の高容量 化は最優先研究課題である。表1に示すよう に、シリコン材料(Si)はLi44Siの合金を形成 しLiを4個以上吸臓することができるため、 現在のカーボン(C)系負極容量 372 mAh/g の 10 倍以上の高容量化が可能である。しかしな がら、Si は、Li イオン取込時の体積膨張率 が420%とカーボンの12%に比べ極めて高く、 充電-放電の繰り返しにより、合金が微粉化 し、そのため寿命が極めて短いという大きな 課題がある。これに対し本研究では、Si と同 様にLi と合金Li₄Ge を形成し、大容量化が 実現可能なゲルマニウム(Ge)に着目した(表 1参照)。Geの利点は高容量化に加え、① Ge 中へのLiイオンの拡散速度がSiより2桁高 く大電流(高出力)が期待できる事、②体積 膨張率が Si の約半分であり、膜の微粉化が 抑制できる事、③狭バンドギャップであるた め、電気導電率が Si の 1000 倍と極めて高く、 導電性が必要な負極材料に極めて適してい る事である。しかしながら、Ge 材料の負極材 開発は、これまでにほとんどないのが現状で ある。

表1:C, Si, Ge 負極材料の比較。本研究 では、Siより体積膨張率が低く、導電率が 高いナノ Ge 系ナノ複合材料を探索し、Li イオン電池の高出力化を実現する。

材量	C	Si	Ge
リチウム合金	LiC ₆	Li _{4.4} Si	Li _{4.4} Ge
比容量 (mAh/g)	372	4198	1625
体積膨張率(%)	12	420	272
導電率 (S/m)	10^{6}	10 ⁻³	1

2. 研究の目的

次世代の高出力Liイオン電池の実現には、 Liを大量に吸臓できる高容量負極材料の開発が必要不可欠である。本研究では、Siより も負極材に適した物性値(高導電率、高容量、 低膨張率)を有する Ge 系材料を用いたナノ 複合膜を、①ナノ粒子生成、②ナノ粒子表面 処理、③ナノ粒子膜堆積を一貫して行える新 規プラズマプロセスで実現する。Ge 系ナノ複 合膜の電気的、機械的特性を、ナノ粒子に関 する①~③の各プロセス(反応性ナノ粒子プ ラズマプロセス)を用いて制御し、高容量Li イオン電池をブレークスルーすることを本 研究の目的とする。

3. 研究の方法

サイズ制御されたゲルマニウムナノ粒子 の生成のために、高圧 RF スパッタリング法 を開発した。図1に実験装置の概略を示す。 ゲルマニウムナノ粒子は、1.5 Torr と比較的 高いガス圧力環境下で、13.56 MHz の RF マグ ネトロンスパッタリング法により生成した。 1 インチサイズのスパッタリングターゲット は、純度 99.99%の多結晶ゲルマニウムを使用 した。1.5 Torr の高いガス圧力環境下で局所 的に高密度のプラズマを生成した。イオンに よるスパッタリングにより、ターゲットから 放出されたゲルマニウム原子の平均自由行 程はミクロンオーダーと短く、ゲルマニウム 原子同士の高頻度の衝突により、プラズマ気 相中でゲルマニウムナノ粒子の核が形成さ れる。また、図1に示すように、アルゴンと 水素の混合ガスを、マグネトロンカソード電 極から基板の方向に向かって比較的速いガ ス流で供給している。ナノ粒子生成の様子を 図1下側に示す。スパッタリングターゲット から放出されたゲルマニウム原子は、アルゴ ン/水素プラズマ気相中で核形成、成長し、 その後、ガス流により下流側に設置した基板 へと輸送される。本法の特徴は、カソード前 面で局所的に生成したプラズマ領域でナノ 粒子を成長させ、その後、サイズを保ったま まガス流により基板へと輸送する点にある。 この方法において、ナノ粒子のサイズは、ナ ノ粒子のプラズマ滞在時間を決めるガス流 速で制御可能である。具体的なナノ粒子膜堆 積のためのプロセス条件は、ガス流量 50~ 250 sccm、プラズマ投入電力 10~50 W、水素 希釈率 RH (H₂/(H₂ + Ar)) 0~60%、基板温度 室温~180℃となっている。



図1:高圧 RF スパッタリング装置図。

4. 研究成果

(1) プラズマ分光計測

まず最初に、RF スパッタリングプラズマの 特性を明らかにするために、スパッタカソー ド前面で局所的に生成されたプラズマの発 光分光計測を行った。典型的な発光スペクト ルを図2に示す。アルゴン原子と水素原子か らの発光に加え、ゲルマニウム原子からの発 光が 300 nm 近辺にはっきりと観測された。 各原子の発光スペクトル強度のプラズマ投 入電力依存性と水素希釈率依存性を図3と図 4 にそれぞれ示す。発光スペクトル強度は、 プラズマ投入電力に比例して増大し、各原子 の数密度は、プラズマ投入電力に比例して増 大した。この結果は、成膜速度をプラズマ投 入電力で制御可能であることを示している。 一方、発光スペクトル強度は、水素希釈率に 対し複雑な依存性を示した。水素原子発光強 度は、水素希釈率 30%程度までは、水素希釈 率に比例して増大し、その後、緩やかに低下 した。これは、結晶構造に多大な影響を与え る水素原子密度が、水素希釈率 30~40%で最 大になることを示唆している。一方、ゲルマ ニウム原子発光スペクトル強度は、水素ガス 添加により大きく低下し、その傾向は、アル ゴン原子発光スペクトル強度とよく一致し た。これは、ゲルマニウムターゲットが、主 にアルゴンイオンの衝突によりスパッタリ ングされていることを示している。



図 2: Ge スパッタリング Ar/H₂ RF 放電プラ ズマの発光スペクトル。



図 3: 発光スペクトル強度のプラズマ投入 電力依存性。



図 4: 発光スペクトル強度の放電アルゴ ンガス水素希釈率依存性。

(2) Ge ナノ粒子含有膜の堆積

開発した高圧 RF スパッタリング法を用い てゲルマニウムナノ粒子含有膜の堆積を行 った。最初にナノ粒子膜の結晶性を評価する ために X 腺回折パターンを測定した。図5に 示すように放電アルゴンガスに水素ガスを 添加することにより、Ge 結晶の(111)面、 (220)面、(311)面に相当するピークが観測さ れ、結晶化に水素添加が有効であることが明 らかになった。また、基板温度を室温から 180℃に上昇させると信号半値幅が 0.28 deg. から 0.17 deg. へと減少し、結晶性が大きく 向上した(図6参照)。

次に水素希釈率 20%、ガス流量 250 sccm、 基板温度を室温に固定し、プラズマ投入電力 をパラメータに成膜を行った。投入電力を10 W から 50 W に増大させた時、成膜レートは 0.0039 nm/s から 0.042 nm/s へと電力に比例 して増大した。この結果は、図3に示した発 光スペクトル強度のプラズマ電力依存性と 良く一致する。図7にナノ粒子含有膜のラマ ンスペクトルを示す。全てのプラズマ投入電 力の膜において 300 cm⁻¹近辺に鋭いピークが 観測され、結晶ゲルマニウムの堆積が確認で きた。このラマンスペクトルを単結晶ゲルマ ニウムのスペクトルと比較したところ、ピー ク位置の低波数側へのシフトが観測された。 このピーク波数シフトから、ナノ粒子の粒径 を導出したところ、結晶粒径は 6.3~6.4 nm と見積もられた。ゲルマニウム材料のエキシ トンのボーア半径は24.3 nm であり、これ以 下の結晶サイズにおいて電子の閉じ込め効 果が顕在化し、量子効果が発現する。これよ り結晶粒径 6 nm を有する本ゲルマニウム結 晶ナノ粒子膜において、多重励起子生成など の量子効果が期待できることが明らかにな った。

また、ナノ粒子の表面終端構造を明らかに するためにフーリエ変換赤外分光測定を行 った。図8に示すようにGeH、GeH2 stretching bondに相当するピークがそれぞれ観測され、 Ge ナノ粒子表面が水素で終端されているこ とが推測された。

さらに、Ge ナノ粒子膜の高導電率化のため に、Ge ナノ粒子膜に Sn を添加した。Ge スパ ッタターゲットの表面の一部に Sn 板を設置 し、Ge と Sn を同時にスパッタした。GeSn ナ ノ粒子膜をラマン分光法で解析したところ、 図 9 に示すように結晶 Ge と比べピークが低 波数側に大きくシフトし、これより結晶 Ge ナノ粒子膜中に Sn が 1 割程度添加されてい ると見積もられた。



図 5: Ge ナノ粒子膜 X 線回折パターンの放 電ガス水素希釈率依存性。



図 6: Ge ナノ粒子膜 X 線回折パターンの 成膜基板温度依存性。



図 7: Ge ナノ粒子膜ラマンスペクトルの放 電供給パワー依存性。





図 9: GeSn ナノ粒子膜のラマンスペ クトル。

(3) Ge ナノ粒子膜を負極材とした Li イオン電池の試作と評価

最後に、Ge 結晶ナノ粒子膜を負極材とした Li イオン電池(2016 コインセル)を試作し、 充放電特性から重量比容量を評価した。初期 容量として理論値に近い約 1600 mAh/g が得 られた。図 10 に示すように充放電のサイク ル数とともに、容量は緩やか低下し、50 サイ クル後の容量は約 600 mAh/g であった。これ は従来型のカーボン負極材電池の 300 mAh/g を大きく超える容量であり、Ge ナノ粒子生 成・堆積プラズマプロセスの Li イオン電池 応用への有効性を示す結果である。



図 10: Ge ナノ粒子膜負極材を用いた Li イオ ン電池重量比容量の充放電サイクル特性。

謝辞

Li イオン電池(2016 コインセル)の試作、な らびに容量評価は東京大学工学系研究科マ テリアル工学専攻の神原淳准教授のご協力 のもと行った。ここに深く御礼申しあげます。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件)

D. Ichida, <u>G. Uchida</u>, H. Seo, K. Kamataki, N. Itagaki, K. Koga, M. Shiratani, Deposition of crystalline Ge nanoparticle films by high-pressure RF magnetron sputtering method, J. Phys.: Conf. Series, 査読有, 518, 2014, pp. 012001-1 - 5.

DOI: 10.1088/1742-6596/518/1/012002

- ② 内田儀一郎,市田大樹,徐鉉雄,古閑一 憲,白谷正治,反応性微粒子プラズマを 用いたゲルマニウム結晶ナノ粒子含有膜 の堆積と量子ドット太陽電池への応用, スマートプロセス学会誌,査読有,4, 2015, pp.6-11.
- ③ M. Shiratani, K. Kamataki, <u>G. Uchida</u>, K. Koga, H. Seo, N. Itagaki, T. Ishihara, SIC nanoparticle composite anode for Li-ion batteries, Mat. Res. Soc. Proceedings, 査読有, 1678, 2014, pp. n08-58-1 - 6. DOI: 10.1557/opl.2014.742

〔学会発表〕(計6件)

- ① <u>G. Uchida</u>, T. Ito, Y. Mino, K. Takenaka, Y. Setsuhara, Development of atmospheric pressure plasma sources for energy device materials processing, International Symposium on Energy Research and Applications, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan, 2017. 2. 9-2. 10.
- ② 内田儀一郎,微粒子プラズマプロセスの 開発とナノ粒子デバイスへの応用展開, 東北大学電気通信研究所 共同研究プロ ジェクト研究「荷電現象がもたらす微粒 子-流体混成系の多様性と機能性」,東北 大学,仙台,2016.9.26-27.
- ③ <u>G. Uchida</u>, K. Koga, M. Shiratani, Measurements of Ar metastable atom and void structure in reactive dusty plasma, 16th Workshop on Fine Particle Plasmas, National Institute for Fusion Science, Toki, Japan, 2015. 12. 10-11.
- ④ <u>G. Uchida</u>, Fabrication of Si and Ge nanoparticle films using discharge plasma and their application to solar cell, Workshop on Nanomaterials for Energy Applications, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Japan, 2015. 9. 29-30.

- ⑤ G. Uchida, Fabrication of Ge nanoparticle composite films hv reactive dusty plasma process for next generation energy devices, The 10^{th} Asian-European International Conference Plasma Surface on Engineering, Ramada Plaza Hotel, Cheju, Korea, 2015.9.20-9.24.
- (6) <u>G. Uchida</u>, D. Ichida, H. Seo, S. Hashimoto, K. Kamataki, N. Itagaki, K. Koga, M. Shiratani, Size-controlled Ge nanoparticle synthesis and their application to quantum-dot solar cells, 15th Workshop on Fine Particle Plasmas, National Institute for Fusion Science, Toki, Japan, 2014. 10. 16-17.
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
 - 内田 儀一郎 (UCHIDA, Giichiro)大阪大学・接合科学研究所・准教授研究者番号:90422435